

# 穿透式電子顯微鏡 TEM

## ◻ 儀器性能： 型號：JEM2000FXII

- 1.解析度：  
格子像 ( Lattice Image ) : 0.14nm  
粒子像 ( Point Image ) : 0.28nm
- 2.試片座傾斜度：±45°
- 3.加速電壓：80~200KV
- 4.放大倍率：50~800K
- 5.電子槍系統：LaB6orW 燈絲
- 6.電子束直徑：1μm~2nm



## ◻ 服務項目：

- 1.材料表面組織、斷面、微細組織、晶體結構及缺陷觀察分析
- 2.全能譜定性(Na11~U92)及半定量分析
- 3.電子繞射晶像判定
- 4.利用離子減薄機、凹片機供使用者薄化各種試片

## ◻ 樣本準備需知：

- 1.粉末採用鍍碳銅網 200~300mesh,D:3mm
- 2.材料薄化者厚度 < 100nm,D:3mm
- 3.試片製作由使用者自理
- 4.樣品須乾燥，在真空無揮發性

## ◻ 收費標準：

- 3,000 元/時段(未持有執照者)  
1,000 元/時段(持有執照者)  
CCD 1,000 元/時段

## ◻ 儀器負責人員連絡方式：

- 儀器專家：李勝隆教授 (03) 4227151#34325  
儀器專家：鄭紹良教授 (03) 4227151#34233  
技術人員：黃智詮先生 (03) 4227151#34009 , allican@ncu.edu.tw

## ◻ 儀器放置地點：

中央大學工程五館 A114 室